

## 光学式膜厚計



光学式膜厚計  
大塚電子（株）  
IMUC-7000SP

平成5年度導入

### 【主な用途・仕様】

シリコン酸化膜等透明薄膜の膜厚測定

- ・測定波長範囲：220～830nm
- ・波長分解能：0.2nm 以下
- ・膜厚測定範囲：0.01～20  $\mu\text{m}$
- ・最小スポット径：4  $\mu\text{m}$

### 【設備使用】

光学式膜厚計

### 【委託分析試験】

マイクロマシニング加工（A）